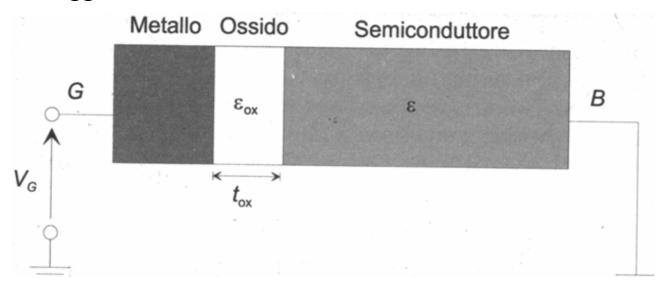
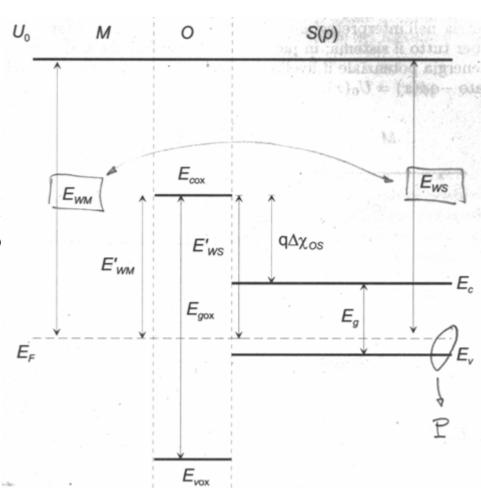
Il Sistema Metallo Ossido Semiconduttore (MOS)

- E' una struttura simile ad un condensatore, con queste differenze:
 - A polarizzazione nulla la concentrazione dei portatori nel semiconduttore è assai minore di quella nel metallo
 - I portatori di maggioranza nel SC possono essere elettroni o lacune
 - Si ha un 'quarto stato' di funzionamento ovvero l'<u>inversione</u> dovuta ad una forte polarizzazione tale da richiamare portatori minoritari tali da prevalere su quelli di maggioranza



- Polarizzazione nulla bande piatte:
 - Il semiconduttore è di tipo P
 - Si hanno gli stessi lavori di estrazione per Me e SC EWM = EWS
 - Durante la formazione della giunzine i diagramma a bande è identico a quello delle singole parti isolate
 - Non si hanno passaggi di cariche a causa dell'ossido, il raggiungimento dell'equilibrio è raggiunto grazie ai collegamenti di gate e di bulk



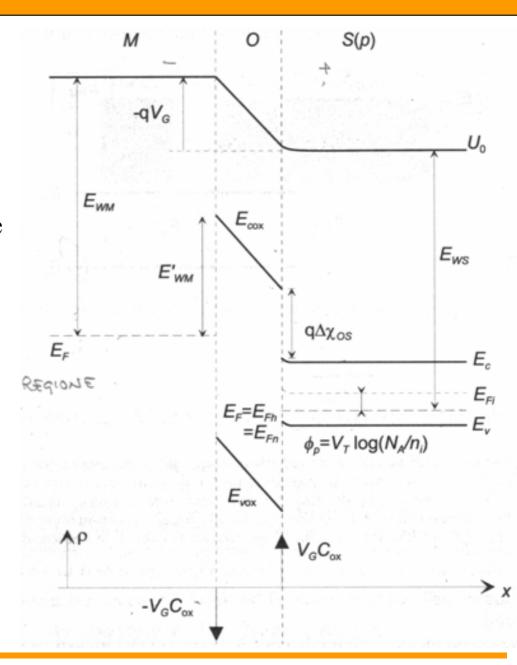
- •Accumulo di Lacune Vg<0:
 - Le lacune vengono attratte verso la superficie del SC-P
 - Si ha accumulo superficiale nel Me
 - I due accumuli sono molto sottili (Debye) → tutto il potenziale cade sull'Ox.
 - La capacità e la carica accumulata sono:

$$C_{ox} = \frac{\varepsilon_{ox}}{t_{ox}} \qquad Q_t = C_{ox}V_G$$

All'interfaccia Ox-SC si ha la condizione:

$$\varepsilon_{ox} \varepsilon_{ox} = \varepsilon_s \varepsilon_s + Q_s$$

$$\varepsilon_s / \varepsilon_{ox} \approx 3$$



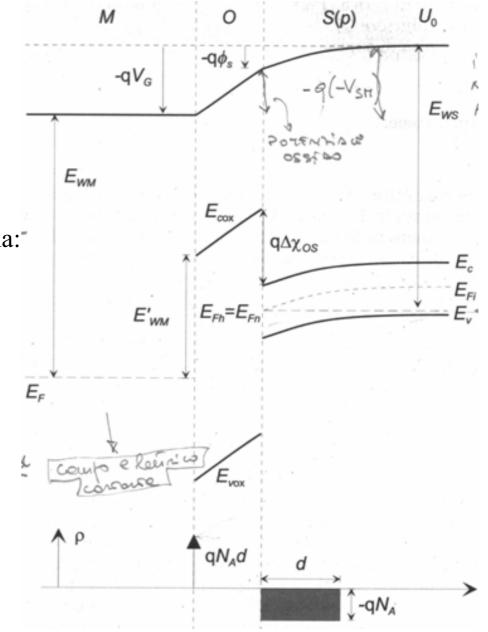
- Svuotamento di Lacune Vg>0:
 - Le lacune vengono respinte determinando una regione di svuotamento $Q_d = -qN_Ad$
 - Per i potenziali sulle varie sezioni si ha:

$$\phi_{ox} = qN_A d \frac{t_{ox}}{\varepsilon_{ox}} = \frac{Q_d}{C_{ox}}$$

$$\phi_s = \frac{qN_A d^2}{2\varepsilon_{ox}}$$

• Legandole al potenziale si ha $V_G = \phi_{ox} + \phi_{sc}$ da cui:

$$\frac{d}{t_{ox}} = -\frac{\varepsilon_{sc}}{\varepsilon_{ox}} + \sqrt{\frac{\varepsilon_{sc}^2}{\varepsilon_{ox}^2} + \frac{2V_G \varepsilon_{sc}}{q N_A t_{ox}^2}}$$

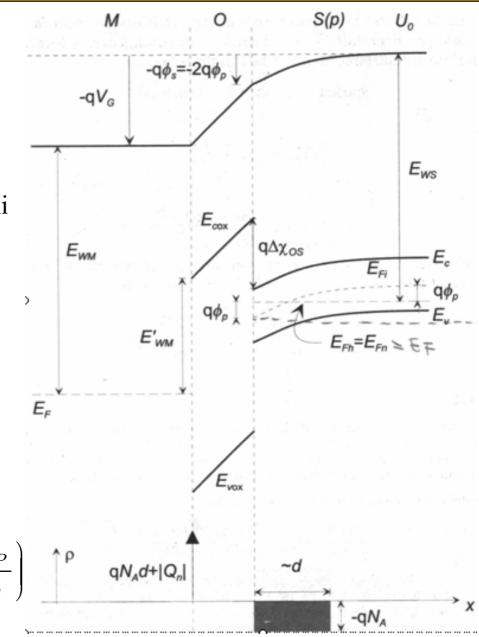


- Inversione di Lacune Vg>>0:
 - Aumentando ulteriormente la polarizzazione, alla superficie si ha l'inversione tra il quasi-livello di Fermi e quello intrinseco.
 - Si crea un canale indotto di tipo n; elettroni che diventano portatori di maggioranza → inversione della popolazione.
 - Si definisce soglia, V_{T0}, quando si verifica la condizione:

$$n(t_{ox}) = N_A$$

da cui:

$$N_A\!=\!n_i\exp\!\left(\frac{E_{Fi}\left(\infty\right)\!-\!E_F}{K_BT}\right)\!=\!n_i\exp\!\left(\frac{q\phi_P}{V_T}\right) \quad \ \ \, \uparrow^{\text{P}}$$



Il Sistema N-MOS ideale: determinazione della V_{TO}

La concentrazione di elettroni è:

$$n(t_{ox}) = n_i \exp\left(\frac{E_F - E_{Fi}(t_{ox})}{K_B T}\right)$$

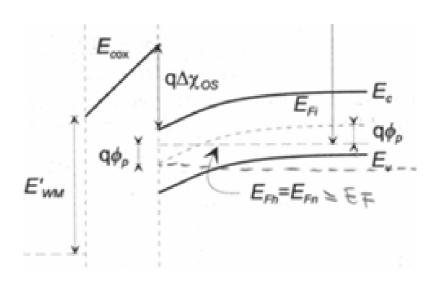
Imponendo la condizione di innesco:

$$E_F - E_{Fi} (t_{ox}) = q \phi_p$$

Si trova il potenziale sul SC:

$$\frac{E_{Fi}(\infty) - E_{Fi}(t_{ox})}{a} = \phi_S = 2\phi_p$$

• A causa dell'andamento esponenziale della carica nel semiconduttore in funzione del potenziale, si può assumere che raggiunta la soglia, il potenziale ϕ_S resti bloccato a $2\phi_p$, conseguentemente la regione svuotata resta costante.



Il Sistema N-MOS ideale: determinazione della V_{TO}

- Con queste ipotesi si calcola la carica del canale, scrivendo la carica totale come: $Q_t = Q_n + Q_d = -C_{ox} (V_G \phi_S)$
- Mentre la carica dello strato di inversione : $Q_d = -qN_Ad$
- Per il potenziale si ha: $\phi_S = 2\phi_p = {qN_A d^2}/{2\varepsilon}$
- Da cui: $Q_d = -\sqrt{2q\varepsilon N_A 2\phi_p}$
- Infine possiamo calcolare la carica come:

$$Q_{n} = Q_{t} - Q_{d} = -C_{ox} (V_{G} - 2\phi_{p}) - \sqrt{2q\varepsilon N_{A} 2\phi_{p}}$$

Sebbene in modo non tutto autoconsistente la carica totale all'inversione è prevalentemente quella fissa, ovvero Q_n ~0, cioè trascurabile rispetto a Q_d . Questo permette di scrivere →

Il Sistema N-MOS ideale: determinazione della V_{TO}

L'espressione della soglia:

$$V_{T0} = 2\phi_p + \frac{\sqrt{2q\varepsilon N_A 2\phi_p}}{C_{or}}$$

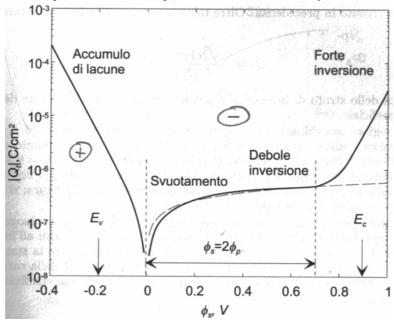
- Per il potenziale si ha: $\phi_p = V_T \log \left(\frac{N_A}{n_i} \right)$
- E per V_G>V_{T0} si ha la legge di controllo della carica:

$$Q_n = -C_{ox} \left(V_G - V_{T0} \right)$$

Per tensioni sopra soglia la carica indotta nel canale dipende linearmente dal potenziale applicato.

Il Sistema N-MOS: analisi esatta in funzione di $\phi_{\rm S}$

Carica totale, calcolata in modo esatto (curva continua) e con il metodo approssimato esposto in precedenza (curva tratteggiata):



Per forte inversione la carica risulta:

$$Q_{t} pprox -rac{\sqrt{2}arepsilon V_{T}n_{i}}{L_{D}N_{A}}e^{\phi_{s}/\!\!\!\!/_{2}V_{T}}$$

Effetto di polarizzazione di canale e substrato

- Ai fini del funzionamento del MOSFET la giunzione *canale-substrato* (N/P) deve essere polarizzata inversamente, in modo che vi sia una barriera di potenziale per gli elettroni verso il substrato.
- In presenza di un potenziale di canale ϕ_{ch} canale e di substrato V_B , la carica totale è:

$$Q_{n} = Q_{n} - Q_{d} = -C_{ox} \left(V_{G} - 2\phi_{p} + \phi_{ch} \right) - \sqrt{2q\varepsilon N_{A} \left(2\phi_{p} + V_{B} \right)}$$

La nuova tensione si soglia si calcola ponendo $\phi_{ch} = 0$ e $Q_n = 0$:

$$V_T = 2\phi_p + \frac{\sqrt{2q\varepsilon N_A \left(2\phi_p - V_B\right)}}{C_{or}}$$

NB: l'assenza del pedice '0'

Effetto di polarizzazione di canale e substrato

Pertanto si conclude che la presenza di un potenziale di substrato cambia la tensione di soglia:

$$V_T = V_{T0} + \gamma_B \left[\left(2\phi_p - V_B \right)^{1/2} - \left(2\phi_p \right)^{1/2} \right]$$

• Dove γ_B è il body factor:

$$\gamma_B = \frac{\sqrt{2q\varepsilon N_A}}{C_{or}}$$

In presenza di un potenziale di canale e di pol. di substrato la relazione del controllo di carica si scrive come:

$$Q_{n} = -C_{ox} \left(V_{G} - \phi_{ch} - V_{T} \right) + \gamma_{B} C_{ox} \left[\left(2\phi_{p} - V_{B} + \phi_{ch} \right)^{1/2} - \left(2\phi_{p} - V_{B} \right)^{1/2} \right]$$

Effetti di non-idealità nei MOS

- Differenza della funzione di lavoro tra metallo e SC $E_{WM} \neq E_{SC}$
 - Se E_{WM} E_{SC} = E_{MS} > 0 si ha passaggio di elettroni dal SC al Me dando luogo ad un accumulo di carica da entrambe le parti

$$|Q_{in}| = C_{ox} E_{MS} / q$$

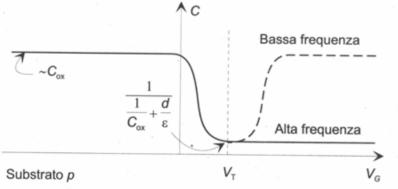
- Cariche nell'ossido
 - Possono essere di diverso tipo: fissa tra Ox-SC di solito positiva, intrappolata durante la realizzazione, carica ionica mobile.
- Le cariche globalmente danno luogo ad una carica indotta nel canale di tipo negativo, quindi il PMOS è vicino all'inversione, il potenziale dovuto per riallineare le bande è V_{fb}.
- La nuova tensione di soglia diventa:

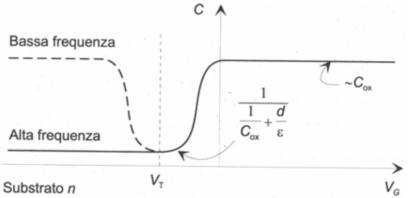
$$V_{T0} = 2\phi_p + \frac{\sqrt{2q\varepsilon N_A 2\phi_p}}{C_{or}} + V_{fb}$$

Caratteristica CV

- Nel sistema PMOS per V_G<0, si ha accumulo con sottile strato la capacità è: C=A*Cox. Questa è una capacità di portatori di maggioranza quindi la capacità non dipende dalla frequenza.
- Al crescere della polarizzazione per $V_G>0$ si passa verso una situazione di SC intrinseco sino ad una serie tra C_{ox} e dovuta allo strato di svuotamento

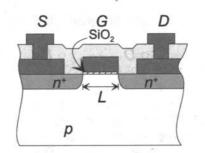
 $\frac{A}{C} = \frac{t_{ox}}{\varepsilon_{ox}} + \frac{d}{\varepsilon_{sc}}$



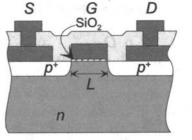


IL MOS Field Effect Transistor (MOSFET)

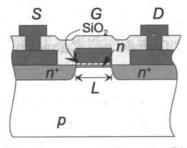
- MOSFET a canale n: substrato di tipo P e strato di inversione formato da elettroni
- MOSFET a canale p: substrato di tipo n e strato di inversione formato da lacune



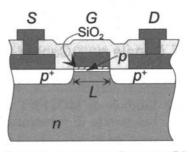
Canale n, normalmente OFF



Canale p, normalmente OFF



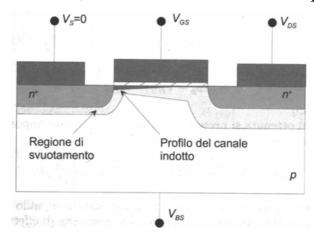
Canale n, normalmente ON



Canale p, normalmente ON

Caratteristica statica del NMOS

- Distribuzione di carica in un NMOS polarizzato oltre la tensione di saturazione
 - La carica nel canale varia passando dal source al drain in quanto la ddp attraverso il canale si riduce, il max si ha in corrispondenza del source.



$$I_D(x) = W \mu_n Q_n (V_{GS}, V_{BS}, \phi_{ch}) \frac{d\phi_{ch}}{dx}$$

$$I_{D} = -\frac{W\mu_{n}}{L} \int_{0}^{Vds} Q_{n} (V_{GS}, V_{BS}, \phi_{ch}) d\phi_{ch}$$

Caratteristica statica del NMOS

Inserendo l'equazione del controllo di carica si ottiene:

$$\begin{split} I_{D} = & \frac{W \mu_{n} C_{ox}}{L} \int_{0}^{V_{ds}} \left(V_{GS} - \phi_{ch} - V_{T} \right) d\phi_{ch} + \\ & - \gamma_{B} \frac{W \mu_{n} C_{ox}}{L} \int_{0}^{V_{ds}} \left[\left(2\phi_{p} - V_{BS} + \phi_{ch} \right)^{\frac{1}{2}} - \left(2\phi_{p} - V_{BS} \right)^{\frac{1}{2}} \right] d\phi_{ch} \end{split}$$

Si riconosce un primo contributo dovuto alla componente lineare del controllo di carica ed il secondo che dipende dalla tensione di canale e di substrato in ogni sezione del canale. Integrando si ottiene:

$$\begin{split} I_{D} = & \frac{W \mu_{n} C_{ox}}{L} \left[(V_{GS} - V_{T}) V_{DS} - \frac{1}{2} V_{DS}^{2} \right] - \gamma_{B} \frac{W \mu_{n} C_{ox}}{L} \times \\ & \left\{ \frac{2}{3} \left[\left(2\phi_{p} - V_{BS} + V_{DS} \right)^{3/2} - \left(2\phi_{p} - V_{BS} \right)^{3/2} \right] - \left(2\phi_{p} - V_{BS} \right)^{1/2} V_{DS} \right\} \end{split}$$

Caratteristica statica del NMOS

• Una versione approssimata della precedente è valida solo quando il body factor è piccolo:

$$I_{D} = \frac{W \mu_{n} C_{ox}}{L} \left[(V_{GS} - V_{T}) V_{DS} - \frac{1}{2} V_{DS}^{2} \right]$$

ullet Si noti che questa relazione è valida solo per $V_{DS} \leq V_{GS} - V_{T}$

$$I_{D} = \begin{cases} \frac{W \mu_{n} C_{ox}}{L} \left[(V_{GS} - V_{T}) V_{DS} - \frac{1}{2} V_{DS}^{2} \right] & V_{DS} \leq V_{GS} - V_{T} = V_{DSS} \\ \frac{W \mu_{n} C_{ox}}{2L} \left[(V_{GS} - V_{T})^{2} \right] \left[1 + \lambda V_{DS} \right] & V_{DS} > V_{GS} - V_{T} = V_{DSS} \end{cases}$$

• Dove λ tiene conto della riduzione del canale per $V_{DS} > V_{DSS}$

Caratteristica statica del MOSFET

Sommario delle caratteristiche elettriche delle varie tipologie di

MOSFET	×		

Circuito equivalente del MOSFET

- Il circuito dinamico del MOSFET è simile a quello di un FET convenzionale, nell'ipotesi di contatto di bulk connesso con il source.
- La limitazione maggiore è dovuta alla presenza del gruppo Rg-Cgs che limita il comportamento in frequenza.

